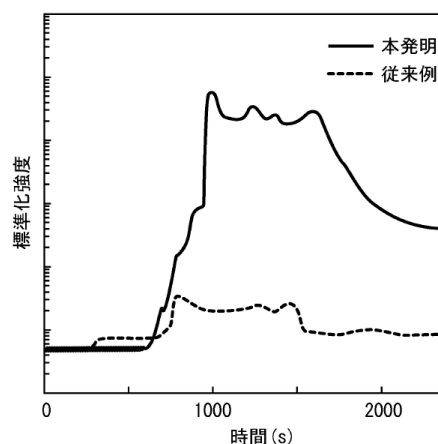
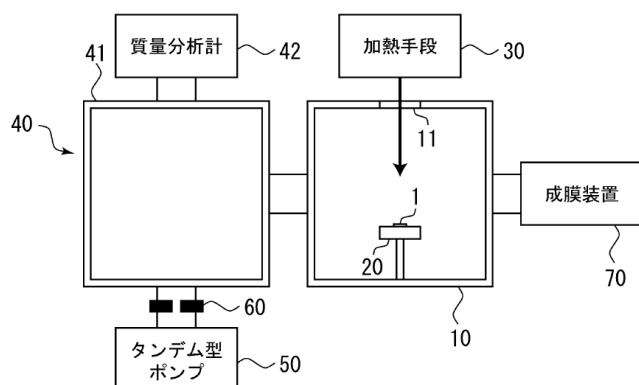


発明の名称：高感度昇温脱離ガス分析装置



【発明の概要】

本発明は高感度昇温脱離ガス分析装置に関し、特に、サンプルから放出される超微小量のガスを検出可能な高感度昇温脱離ガス分析装置に関する。



【応用分野・適用製品】

水素濃度の分析装置、水素検出装置など。

【産学連携会員企業の皆様へのアピールポイント！】

半導体の水素の効果と挙動は注目されているが、低濃度の水素の測定ができていなかった。本手法により、強誘電体では水素還元での劣化、GaNなどのアクセプタの不活性化の起源、酸化物半導体のn型キャリアの起源解析、光劣化の解析に用いることができる。

【本発明の特許出願情報】

出願番号：特願 2017-034677

出願日：2017/02/27

発明者：東京工業大学 科学技術創成研究院 教授 細野 秀雄、
東京工業大学 元素戦略研究センター 研究員 半那 拓、
東京工業大学 科学技術創成研究院 准教授 平松 秀典

出願人：国立大学法人東京工業大学

【開示の整理番号】 東 17_006 (16T127)

【お問い合わせ先】

国立大学法人東京工業大学 研究・産学連携本部
〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1

TEL : 03-5734-2445 FAX : 03-5734-2482

E-mail : sangaku-at-sangaku.titech.ac.jp アドレス内の[at]は@に置き換えてご送信ください。